

Pressa A Caldo Automatica Per Laboratorio: Sistema Di Sinterizzazione E Compattazione A Doppia Piastra Riscaldante 120X120Mm

Numero articolo: KT-AHQ



Introduzione

Questa pressa a caldo automatica per laboratorio combina compattazione idraulica di alta precisione con riscaldamento indipendente a doppia piastra fino a 300°C, offrendo controllo programmabile multistadio e raffreddamento rapido ad acqua per massimizzare efficienza e coerenza dei campioni in ambienti di ricerca e laboratorio industriali esigenti.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Ricerca sull'energia delle batterie	Fabbricazione di dischi di elettroliti allo stato solido e componenti per celle a bustina di batterie al litio a temperatura e pressione controllate.	Massimizza la densità elettrochimica e la conducibilità, garantendo risultati ottimali nei test delle celle della batteria.
Test farmaceutici	Compattazione di polveri farmaceutiche, eccipienti e principi attivi in compresse o provini precisi.	Garantisce una formulazione esatta della dose e un'eccellente coerenza strutturale per i test di dissoluzione.
Ceramiche avanzate	Sinterizzazione e compattazione di elettroceramiche, polveri di ossido e materiali ceramici strutturali ad alta pressione termica.	Elimina porosità e vuoti interni, fornendo pezzi ad alta densità con resistenza meccanica superiore.
Ingegneria dei catalizzatori	Pressatura di miscele di polveri di catalizzatore in pellet o substrati catalitici altamente attivi e durevoli.	Ottimizza l'area superficiale attiva garantendo al contempo stabilità meccanica a lungo termine negli ambienti dei reattori.
Preparazione di campioni per spettroscopia	Preparazione di film polimerici ultra-sottili e dischi ottici altamente uniformi per FTIR e spettrofotometria di fluorescenza.	Elimina le variazioni di spessore, migliorando l'accuratezza e la ripetibilità dei risultati analitici.
Imballaggio di semiconduttori	Laminazione di substrati elettronici, materiali di interfaccia termica e composti per stampi di semiconduttori a forza precisa.	Previene la delaminazione e garantisce percorsi uniformi di dissipazione termica attraverso i componenti.

Parametro di specifica	Dati tecnici (Modello: KT-AHQ)
Dimensioni piastra di pressatura	120 mm x 120 mm
Temperatura massima	300°C (Controllo indipendente piastra superiore e inferiore)
Metodo di controllo della temperatura	Controllo intelligente a circuito chiuso PID a doppia zona
Precisione della temperatura	±1°C
Forza di pressatura massima	20 Tonnellate (Opzioni personalizzabili disponibili)
Meccanismo di raffreddamento	Sistema integrato di raffreddamento rapido ad acqua
Modalità operative	Modalità Standard (monostadio) & Modalità Avanzata (multistadio)
Passaggi programmabili	Programmazione di fino a 18 passaggi
Display e interfaccia utente	Touchscreen a colori da 7 pollici con visualizzazione di curve grafiche
Interfaccia dati	Porta USB per registrazione ed esportazione dati (formato CSV)

Parametro di specifica	Dati tecnici (Modello: KT-AHQ)
Schermo di sicurezza	Cuffia protettiva trasparente in acrilico / policarbonato
Alimentazione	220V AC, 50/60 Hz, Monofase (110V opzionale)